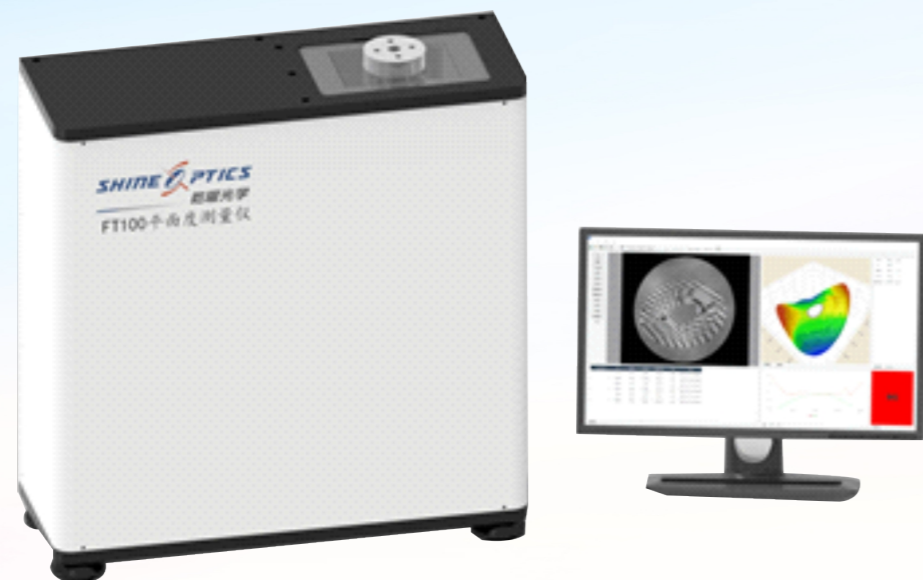


## FlaTester平面度测量仪家族 新

快速准确地测量机加工、研磨、抛光和超精密加工的样品表面形状

现代精密制造中，当需要确定整个表面的平整度，单线扫描仪和三坐标测量仪都因为测量的数据量太少而无法要求，我们的FlaTester平面度测量仪可以在几秒钟内非接触地测量零件的整个表面，不同尺寸和复杂形状均可测量。

FlaTester的分辨率达到5nm，准确度为50nm。保证可以快速、精确测量平面度、线形、半径等各种表面参数，并且适用于多种材料和表面处理方式。

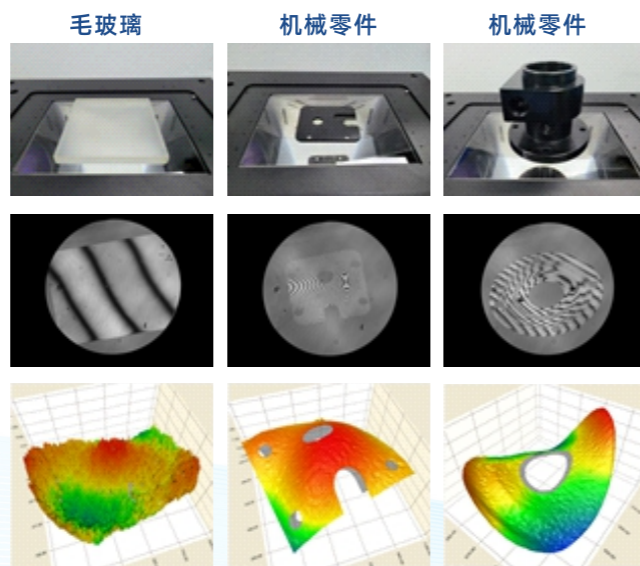


### 关键性能

- ▶ 非接触、无损伤测量
- ▶ 最大达到100 $\mu$ m的动态测量范围
- ▶ 光学量级的分辨率和精度
- ▶ 秒级实现整个表面特征的测量
- ▶ 可以测量多种材料：半导体晶圆、LCD掩膜、玻璃、金属、复合材料、陶瓷等
- ▶ 适用多种类型表面：机加工表面、研磨表面、抛光面，超光滑面等

### 好学易用

- ▶ 无需工装夹具，放置好样品即可测量
- ▶ 软件操作方便，界面友好，直观展现样品的二维和三维轮廓
- ▶ 测量结果客观，不易受作业员操作影响
- ▶ 适用于生产现场、质量控制和开发验证等多种场合，提高产品质量和产品，提升品质直通率



### 仪器规格参数表

产品型号	FT100	FT200
结构形式	倒立式	
测量方式	掠入射	
光源	氦氖激光 (632.8nm)	
相机	靶面1/1.2"，有效分辨率1.2KX1.2K	
有效通光口径	100mm	200mm
样品尺寸	25-100mm	25-200mm
量程	>100 $\mu$ m	>100 $\mu$ m
精度	50nm	50nm
重复性	15nm (标准偏差)	
测量时间	5秒	
测量数据点	最高达23万个点	
测量基准	小二乘法	
可测量材料	半导体晶圆、LCD掩膜、玻璃、金属、复合材料、陶瓷等	
可测量表面	机加工表面、研磨表面、抛光面，超光滑面等	
样品反射率	85°入射角R>10%	
样品粗糙度	Ra<1.0 $\mu$ m	
仪器尺寸(长宽高)	700x260x720mm	700x340x720mm
仪器重量	96KG	110KG
电源	100-240VAC, 50/60Hz	
工作环境温度	15°C - 30°C	
温度变化率	<1.0°C/30min	
湿度	不大于70%	